# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

' (11)Publication number:

04-139093

(43)Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.Cl.

C30B 29/28 C30B 19/00

(21)Application number : 02-258550

(71)Applicant: TOKIN CORP

(22)Date of filing:

27.09.1990

(72)Inventor: HONDA YOICHI

# (54) PRODUCTION OF BISMUTH SUBSTITUTED RARE EARTH IRON GARNET

# (57) Abstract:

PURPOSE: To improve performance by growing a single crystal film while dropping the melt temp. for forming the grown film during the growth of the film in such a manner that the fluctuation in the lattice constant in the growth direction of the single crystal film is controlled to a specific value or below.

CONSTITUTION: Prescribed mol of a rare earth oxide and Bi2O3 are melted in a flux, such as PbO, to form the melt. A single crystal substrate of nonmagnetic

A single crystal substrate of nonmagnetic gadolinium/gallium/garnet having the bearing in a (111) direction is immersed into the melt heated to a prescribed temp. The film is grown for a prescribed period of time while the melt temp. to form the grown film is dropped in such a manner as to control the fluctuation in the lattice constant in the grown direction of the single crystal film is controlled to  $\leq \pm 0.003\&$ angst; on the basis of the lattice

constant at the time of starting the growth, by which the single crystal film of the large-diameter bismuth substd. rare earth/iron/garnet expressed by formula  $(0.2 \le X \le 2.5, 0 \le Y \le 2.0, R$  is Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Tm, Yb, Lu, Y, M are Al, Ga), such as bismuth-substd. terbium/iron/garnet, is obtd.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

Ro-xBixFes-vHvO12

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

. [Date of extinction of right]

9日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-139093

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月13日

C 30 B 29/28 19/00 7158-4G S 8924-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

ビスマス置換希土類鉄ガーネツトの製造方法

②特 願 平2-258550

②出 願 平 2 (1990) 9月27日

**個発明者 本田** 

洋 一 茨城県つくば市大字花島新田字北原28番1号 株式会社ト

ーキン内

勿出 願 人 株式会社トーキン

官城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号

# 明 細 書

#### 1 発明の名称

ピスマス置換希土類鉄ガーネットの製造方法

#### 2 特許請求の範囲

1. LPE法によるピスマス(BI)置換希土類鉄ガーネット(化学式 $R_3-xBi_xFe_5-vMvO_{12}$ で示した時、 $0.2 \le X \le 2.5$ 、 $0 \le Y \le 2.0$ 。但し、RはNd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Er、Tm、Yb、Lu、Yで示される元素のうち少なくとも1種類、MはAl、Gaで示される元素のうち少なくとも1種。)単結晶膜の育成において、単結晶膜の成長方向の格子定数の変動を、育成開始時の格子定数を基準として±0.003オングストローム以下に制御するよう、単結晶膜の育成中に育成度を形成する融液温度を降下させながら膜育成を行うことを特徴とするピスマス置換希土類鉄ガーネットの製造方法。

以下余白

#### 3 発明の詳細な説明

### イ、発明の目的

#### [産業上の利用分野]

本発明は、ファラデー素子用ピスマス置換鉄ガーネットの製造方法に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

# 特開平4-139093 (2)

# (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、LPE法により数百μ aの厚さまで割れの発生なしで育成出来るピスマス置換希土 類鉄ガーネット単結晶厚膜の寸法はたかだか1.5インチ径までであり、さらに大きな寸法のものを育成しようとすると割れが発生するという問題があった

これは、ビスマス置換希土類鉄ガーネット単結 品を育成する際に使用される融液のビスマスと希 土類の濃度比が、育成されるビスマス置換希土類 本発明は、単結晶育成の規模を拡大せずに、割れのない大口径のピスマス関換希土類鉄ガーネット単結晶厚膜をLPE法により育成し、高性能で、しかも極めて低価格のファラデー素子を提供することにある。

以下余白

#### ロ、発明の構成

# (課題を解決するための手段)

本発明は、ピスマス置換希土類鉄ガーネット単結晶膜の育成中に、育成温度を徐々に降下させることで成長方向での格子定数変動及びそれに伴う応力の発生を抑制し、割れのない大口径の厚さが数百μ■のピスマス置換希土類鉄ガーネット単結晶膜を得るものである。

即ち本発明は、LPE法によるピスマス (Bi) 置換 和土類鉄ガーネット (化学式  $R_{3-x}$  Bi x Fes -y My O  $_{12}$  で示した時、 $0.2 \le X \le 2.5$ ,  $0 \le Y \le 2.0$ . 但し、R は Nd、Se. Eu. Gd. Tb, Dy. Er. Ta. Yb, Lu. Yで示される元素のうち少なくとも 1 種類、M は Al. Gaで示すのおりち少なくとも 1 種。) 単結晶膜の育成において、単結晶膜の成長方向の格子定数の変動を、育成開始の格子定数を基準として±0.003オングストローム以下に制御するよう、単結晶膜の育成中に育成膜を形成すると、単結晶膜の育成中に育成膜を形成するとで、単結晶膜のがら膜育成を行うことを特徴とするピスマス置換 希土類鉄ガーネットの製造方法である。

#### (作用)

本発明者は、このような融液中の希土類濃度が時間に伴い減少する状態で育成開始の融液温度を保ってピスマス置換希土類鉄ガーネット単結晶膜の育成を続けると、単結晶膜中の希土類濃度は増加し、ピスマス濃度は減少し、格子定数の値が小さくなって行くことを実験的に見いだした。即ち

# 特閒平4-139093 (3)

メルト中の希土類元素の濃度は減少しているのに もかかわらず結晶中の希土類濃度が増加するのは、 ピスマスの偏析が融液の組成に依存しているため である。この場合、ピスマスのイオン半径が希土 類のそれに比べて大きいために、膜の成長方向で 格子定数が小さくなっていく。

ところで、LPE法によるピスマス置換希土類 鉄ガーネット単結晶膜の育成におけるピスマスの 偏析は育成温度に依存し、育成温度が低い程ピス マスの混入量が大きくなることが知られている。

これらの事実をふまえて、本発明者はLPE法によるピスマス置換希土類鉄ガーネット単結基膜の育成において、育成中に融被温度を降下させて単結晶膜の格子定数の変動を抑制し、単結晶膜の割れの発生を防止することを特徴とするピスマス置換希土類鉄ガーネットの製造方法を完成するにいたったのである。

#### 〔実施例〕

以下に実施例と比較例を用いて本発明を説明する。

育成開始から育成終了まで12.496±0.002オングストロームの範囲であった。

### (実施例2)

実施例1で用いた融液と、同組成、同量の融液 を用い、方位が {111} 方向の非磁性カルシウム・マ グネシウム・ジルコニウム置換ガドリニウム・ガ リウム・ガーネット(GdCa)3(GaNgZr)5012の3イン チ径単結晶基板に、LPE法によりピスマス置換 テルビウム鉄ガーネット(TbBi) 3 Fe 5012単結晶厚膜 を50時間にわたり育成した。育成開始時の融液の 温度は基板格子定数 (12.496A)と膜の格子定数が一 致した800℃であり、育成中0.3℃/時間の降温速 度で降温し、育成終了時は785℃であった。その結 果500μmの厚さの、割れのない(TbBi)3FesO12単結 晶膜が得られた。この(TbBi)っFesO12単結晶膜の成 長方向での格子定数を閲査したところ、第1表に 示すような結果が得られた。即ち格子定数は、育 成開始から育成終了まで12.496±0.002オングスト ロームの範囲であった。

以下余白

#### (宝飯領1)

酸化テルビウム(Tb2O1)を1モル%、酸化鉄 (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を9モル%、酸化ビスマス(Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を25モ ル%、酸化鉛(PbO)を50モル%、酸化ポロン(B2O3) を15モル%をそれぞれの比で鉛重量 5 kgを溶解混 合した融液(この融液と同じ組成、同量の融液を 以下の実施例2、比較例1、比較例2でも使用し た)を用い、方位が {111}方向の非磁性のカルシウ ム・マグネシウム・ジルコニウム便換ガドリニウ ム・ガリウム・ガーネット(GdCa) 1 (GaMgZr) 5012の 2インチ経単結晶基板に、LPE法によりピスマ ス 置換テルビウム鉄ガーネット(TbBi)っFesO12単結 晶厚膜を50時間にわたり育成した。育成開始時の 監核の温度は基板の格子定数(12.496A)と膜の格子 定数が一致した800℃であり、育成中0.1℃/時間 の降温速度で降温し、育成終了時は795℃であった。 その結果500μmの厚さの割れのない(TbBi)<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 単結晶膜が得られた。この(TbBi)3Fe5012単結晶膜 の成長方向での格子定数を調査したところ、第1 表に示すような結果が得られた。即ち格子定数は、

### (比較例1)

実施例1で用いた融液と同組成、同量の融液を 用い、方位が{111}方向の非磁性カルシウム・マグ ネシウム・ジルコニウム置換ガドリニウム・ガリ ウム・ガーネット(GdCa) 3 (GaMgZr) 5012の2インチ 径単結晶基板に、LPE法によりピスマス置換テ ルピウム鉄ガーネット(TbBi)3Fe5012単結晶厚膜を 50時間にわたり育成した。育成開始時の融液の温 度は基板格子定数 (12.496A)と膜の格子定数が一致 した800℃であり、育成中も温度を変化させること なく800℃を保った。その結果500μ ■の厚さの、 (TbBi) ₃FesO12単結晶膜が得られたが、膜に割れが 生じた。この(TbBi)₃Fe₅O₁₂単結晶膜の成長方向で の格子定数を調査したところ第1表に示すような 結果が得られた。即ち格子定数は育成開始から育 成終了まで次第に小さくなり、育成終了時では 12.484オングストロームであった。

### (比較例2)

実施例 1 で用いた融液と同組成、同量の融液を 用い、方位が {111} 方向の非磁性カルシウム・マグ

# 特開平4-139093 (4)

示される元素のうち少なくとも 1 種、X 及び Y は  $0.2 \le X \le 2.5$ ,  $0 \le Y \le 2.0$ ) 単結晶膜の育成全般に適用されるものである。

以下余白

ネシウム・ジルコニウム置換ガドリニウム・ガリウム・ガーネット (GdCa) (GaMgZr) 5012の3インチ 任単結晶基板にLPE法によりピスマス置換テルピウム鉄ガーネット (TbBi) 3Fe 5C12単結晶厚膜を50時間にわたり育成した。育成開始時の融液の温度は基板格子定数 (12、496A)と膜の格子定数が一致した800℃であり、育成中も温度を変化させることなく800℃に保った。その結果500μmの厚さの、

(TbBi) 3FesO12単結品膜が得られたが膜に割れが生じた。この(TbBi) 3FesO12単結晶膜の成長方向での格子定数を調査したところ、第1表に示すような結果が得られた。即ち格子定数は育成開始から育成終了まで次第に小さくなり、育成終了時では12.472オングストロームであった。

本発明における実施例、比較例について説明したが、本発明はその原理により上記実施例のみならず、LPE法によるピスマス (B1) 置換希土類鉄ガーネット (化学式R3-xBixFes-xNvO12で示される。但し、RはNd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Tm, Yb, Lu, Yで示される元素のうち少なくとも1種類、MはA1, Gaで

		Ì	Ì			f						ŀ
							育成団站(0 mm)から育成計了(5 0 0 mm)までの格子定数	(0μm 子來教	# C & C	成件了(	2000	Ê
	<b>新</b> 章	医性性性	有成符了語來	性度	E	Ę	E	1 0 0 II II	200 µm	300 FB	100 µµ	30
文法所1	0.0	800	795 0. 1 C C/H	0	500 E H	2	12.498 Å	12.498 A	12.498 12.498 12.497 12.496 A A A A	12.496 A	12.497 A	12.4
女施別2	80	800	785 t	0.3 7/H	500 En H	つな		12.496 12.496 A A	12.495 A	12.494 A	12.494 A	~
光数第1	0 TE	800 C	800	4 C H	500 mm	5.5	12. 498 A	12.194 Å	12.194   12.192 A A	12.490 A	12.487 A	2
比松餅2	0 15		8	C C C H	500 um	3.0	12.496 A	12.493 Å	12.493 12.489 12.484 12.478 A A A A A	12.484 A	12. 178 A	2

O E 88 4 88 4 57 4

# ハ、発明の効果

### (発明の効果)

以上説明したように、本発明によるLPE法による単結晶育成時に一定範囲の割存を踏出することにより、育成の規模を拡大するとなく、割れのない大口径ピスマス置換希土類がガーネット単結晶膜をLPE法により育成し、高性能でしかも極めて低価格のファラデー素子を提供することが出来るようになった。

特許出願人 株式会社トーキン